

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年3月11日(11.03.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/044791 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/673 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/029897

(22) 国際出願日: 2020年8月4日(04.08.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2019-159877 2019年9月2日(02.09.2019) JP

(71) 出願人: 村田機械株式会社 (MURATA MACHINERY, LTD.) [JP/JP]; 〒6018326 京都府京都市南区吉祥院南落合町3番地 Kyoto (JP).

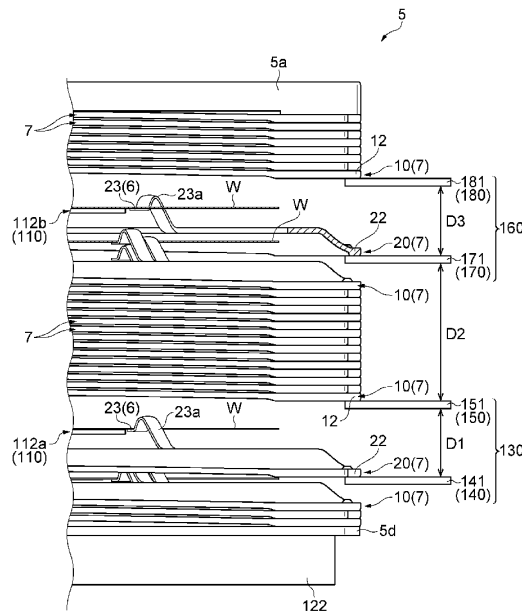
(72) 発明者: 虎澤 政佳 (TORAZAWA Masayoshi); 〒4848502 愛知県犬山市大字橋爪字中島2番地 村田機械株式会社犬山事業所内 Aichi (JP).
中村 陽一 (NAKAMURA Yoichi); 〒6128686 京都府京都市伏見区竹田向代町136番地 村田機械株式会社内 Kyoto (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: WAFER DELIVERY DEVICE, WAFER STORAGE CONTAINER, AND WAFER STORAGE SYSTEM

(54) 発明の名称: ウェハ受渡装置、ウェハ貯蔵容器、及びウェハ貯蔵システム



(57) Abstract: In this wafer storage container, a first ring part including a first supported part, which is formed in a first position when viewed in a plan view, and a second ring part including a second supported part, which is formed in a second position when viewed in a plan view, are alternately superposed in the vertical direction. This wafer delivery device comprises first and second ring support parts, a raising/lowering part, and a delivery part. The first ring support part has: a first support piece the vertical position of which is fixed; and a first driving mechanism that drives the first

[続葉有]

WO 2021/044791 A1

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

support piece. The first driving mechanism selectively establishes any one among a first state in which the first support piece is superposed on the first position when viewed in a plan view, a second state in which the first support piece is superposed on the second position when viewed in a plan view, and a third state in which the first support piece is not superposed on the first and second positions when viewed in a plan view.

(57) 要約: ウェハ貯蔵容器では、平面視で第1位置に形成された第1被支持部を含む第1リング部と、平面視で第2位置に形成された第2被支持部を含む第2リング部と、が上下方向に交互に積み重ねられる。ウェハ受渡装置は、第1及び第2リング支持部、昇降部及び受渡部を備える。第1リング支持部は、上下方向の位置が固定された第1支持片と、第1支持片を駆動する第1駆動機構と、を有する。第1駆動機構は、平面視で第1支持片が第1位置と重なる第1状態と、平面視で第1支持片が第2位置と重なる第2状態と、平面視で第1支持片が第1及び第2位置と重ならない第3状態と、の何れかを選択的に成立させる。